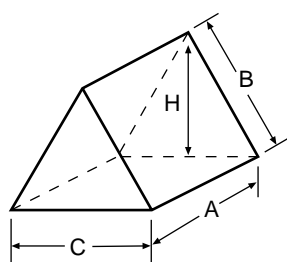


二等辺ブリュースタープリズム



フェムト秒レーザーのためのGVD (群速度分散) 補正プリズム

2面を光学研磨

170 nmの波長にはSuprasil 1をご用意
P-偏光ビームのロスが非常に小さい
他の寸法や材質にも対応可能

基板材質	Suprasil 1、UVグレードフューズドシリカ、LaFN28、LaKL21、またはSF10
平面度	/10(@633 nm)
表面品位	Suprasil 1およびUVグレードフューズドシリカ : 10-5、CVIレーザークオリティ LaFN28、LaKL21、およびSF10 : 30-10 (MIL-PRF-13830Bによる)
寸法公差	+ 0.00 mm、 - 0.25 mm
角度公差	± 2分
面取り	0.35 mm、45 °標準
有効寸法	中心の85%以上
損傷しきい値	Suprasil 1 : 15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm) フューズドシリカ : 15 J/cm ² 、20 ns、20 Hz(@1064 nm)

分散プリズムは、白色光に含まれる波長成分の分離に使用されます。一般的に、先ず光がコリメートされ、その後プリズムにより分散されます。その後、個々のスペクトルはレンズまたは球面ミラーの焦点面に集光されません。

分散プリズムは、レーザービームに含まれる2つの波長の分離に使用されます。通常、分散されたビームは遠くへ行くことにより空間的な分離が十分となります。

分散プリズムは、ビームの入射角度と出射角度が異なっていた場合に、分散面において倍率を呈します。これは、1方向に対するビームのアナモルフィック的な拡大または縮小に便利であり、非対称ビームプロファイルの整形または生成に使用されます。

このプリズムの使用方法に関する詳細については、「分散プリズムの使用について」をご参照ください。

LaFN28、およびLaKL21の硝材を使用した製品については、在庫状況をお問合せください。

二等辺ブリュースタープリズム

製品番号	高さ H (mm)	寸法 A (mm)	寸法 B* (mm)	寸法 C* (mm)	頂角 (°)	材質	屈折率 (@633 nm)
IB-10.5-68.7-SS	10.5	7.9	12.7	14.4	68.7	Suprasil 1	1.45702
IB-15.0-68.7-SS	15.0	12.7	18.2	20.6	68.7	Suprasil 1	1.45702
IB-19.0-68.7-SS	19.0	12.7	23.0	26.0	68.7	Suprasil 1	1.45702
IB-12.4-69.1-UV	12.4	15.0	15.0	17.0	69.1	フューズドシリカ	1.45702
IB-13.0-59.2-LaFN28	13.0	15.0	15.0	14.8	59.2	LaFN28	1.76988
IB-12.8-63.0-LaKL21	12.8	15.0	15.0	15.7	63.0	LaKL21	1.63821
IB-13.0-60.6-SF10	13.0	15.0	15.0	15.1	60.6	SF10	1.72307
IB-21.6-60.6-SF10	21.6	25.0	25.0	25.2	60.6	SF10	1.72307

* 寸法は、理論上の頂点までの値です。